

半導体用特殊材料ガス/高純度・超高純度キャリアガス供給用

① 1段減圧式 最大流量: 50ℓ, 150ℓ/min. (標準状態)
1次圧力: 20.0MPa以下, 調整圧力: 0.1~1.0MPa

Heリーク値:
5×10⁻¹¹Pa・m³/sec.以下

エクセレント・メガ・シリーズ (電解研磨品)

EX-M-20/EX-M-100...MR (認定品) シリーズ

I 一般工業ガス用
圧力調整器

II 分析用標準ガス・
理科実験用
圧力調整器

III 半導体用特殊材料ガス
高純度・超高純度
キャリアガス用圧力調整器

IV 一般工業ガス
供給設備・機器

V 分析用標準ガス
供給設備・機器

VI 半導体用特殊材料ガス
高純度・超高純度
キャリアガス供給設備・機器

VII 大臣認定について

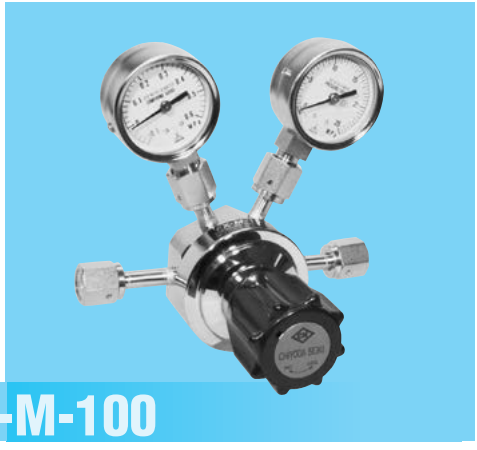
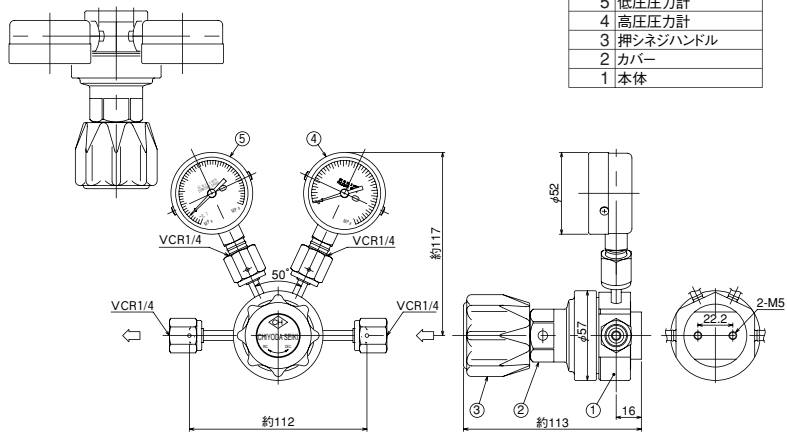
VIII 高圧ガス法律

IX 参考資料



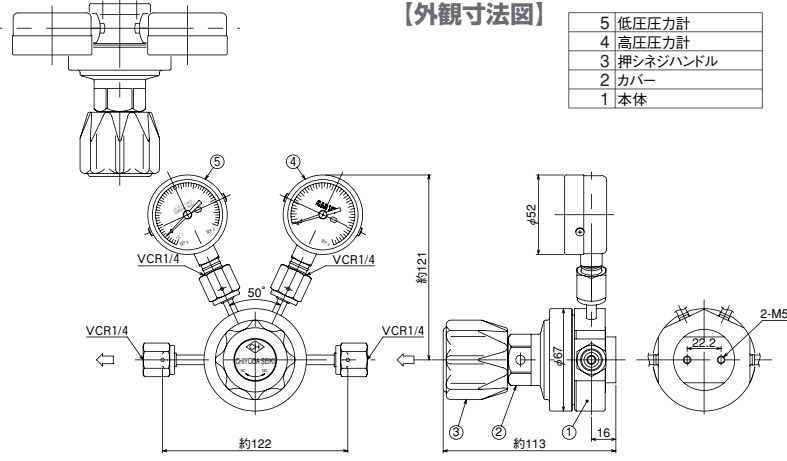
EX-M-20

【外観寸法図】

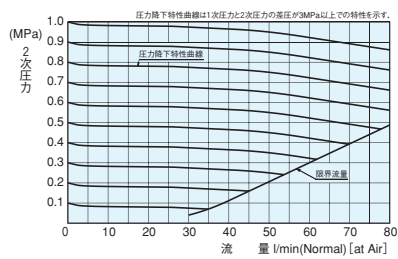


EX-M-100

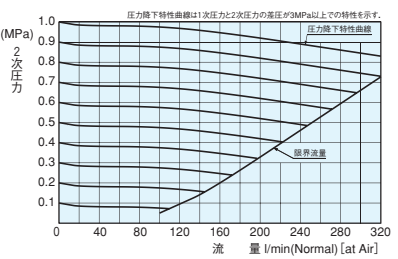
【外観寸法図】



【EX-M-20型 流量表】



【EX-M-100型 流量表】



【特長】

- 外部リーク5×10⁻¹¹Pa・m³/sec.以下の超気密構造。
- パーティクルを極限まで抑えた、超清浄仕上げ。
- 超清浄処理を行った圧力計 (クリーンM) を使用。(接ガス部は、全てEP (電解研磨・VCR継手込み) 処理を施しています。)

【用途】

- 超LSI製造用高純度ガスの供給システム
- 超高純度ガス、混合ガスの供給システム
- 超清浄度、超高純度を必要とする各種ガスシステム

【標準仕様】

仕様	型式	EX-M-20	EX-M-100
	認定品	MR-EX-M-20	MR-EX-M-100
グレード		M	M
適用ガス		超高純度ガス	超高純度ガス
材質	本体	SUS316L-EP (電解研磨) 処理	SUS316L-EP (電解研磨) 処理
	ダイヤフラム	SUS316-EP (電解研磨) 処理	SUS316-EP (電解研磨) 処理
	シート	SUS316L-EP (電解研磨) 処理	SUS316L-EP (電解研磨) 処理
1次圧力		20.0MPa以下	
調整圧力		0.1~1.0MPa	
標準流量		0~20ℓ/min (標準状態)	0~100ℓ/min (標準状態)
最大流量		50ℓ/min (標準状態)	150ℓ/min (標準状態)
最大CV値		0.05	
使用温度		-10~+60℃	
露点温度		-74℃以下	
He外部リーク値		5×10 ⁻¹¹ Pa・m ³ /sec以下	
1次圧力計		0~25MPa, 0~35MPa	
2次圧力計		-0.1~0.6MPa (尚、ご使用圧力により選択いたします。)	
入口接続		VCR1/4 (EP)	VCR1/4 (EP) VCR3/8 (EP)
出口接続		VCR1/4 (EP)	VCR1/4 (EP) VCR3/8 (EP)
質量		1.2kg	1.3kg

認定品仕様 - MRシリーズ

御注文時に下記項目をご指定下さい

- 型式・流体名
- 右高圧/左高圧
- 1次/2次設計圧力
- 1次/2次圧力計
- 入口/出口継手形状